⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 254394

@Int_Cl_4

①出 願

識別記号

鐘淵化学工業株式会社

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)11月6日

H 05 B 33/14 C 09 K 11/00 7254-3K F-7215-4H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

◎発明の名称 薄膜 E L 索子及びその製造法

②特 願 昭61-97179

②出 願 昭61(1986)4月25日

72発明者 横山

人

昌 夫

神戸市垂水区塩屋町6丁目31番17号 三青荘

⁶ 短発 明 者 七 尾 勉

神戸市須磨区中落合1丁目1番地413-106 大阪市北区中之島3丁目2番4号

冠代 理 人 弁理士 伊丹 健次

明細物

1. 発明の名称

薄膜EL索子及びその製造法

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 多結晶硫化亜鉛薄膜を用いたEし素子において、硫化亜鉛の粒界に絶縁性金属酸化物を折出させた層を有することを特徴とする薄膜Eし素子
- 2. 硫化亜鉛薄膜が粒子堆積構造を有している ことを特徴とする特許請求範囲第1項記載の薄膜 EL素子。
- 3. 多結晶硫化亜鉛彈膜を用いたBL素子を製造するに際し、硫化亜鉛の粒界に絶縁性金属酸化物を折出させることを特徴とする薄膜BL素子の製造法。
- 4. 硫化亜鉛薄膜を成膜後、金属酸化物前駆体溶液を硫化亜鉛薄膜上に塗布乾燥した後加熱処理をすることにより、硫化亜鉛粒子の粒界に絶縁性金属酸化物を折出させる特許請求の範囲第3項記載の製造法。

- 5. 惣布法硫化亜鉛薄膜の成膜時に、予め惣布 被中に絶縁性金属酸化物前駆体溶液を加えておき 硫化亜鉛薄膜合成と同時に粒界に絶縁性金属酸 化物を析出させる特許請求の範囲第3項記載の製 造法。
- 6. 金属酸化物的駆体溶液中にコロイド状硫化 亜鉛を加えて均一に分散させたのち、基板上に塗 布し乾燥後加熱処理を施して硫化亜鉛粒子の粒界 に絶縁性金属酸化物を析出させる特許請求の範囲 第3項記載の製造法。
- 7. 硫化亜鉛藻膜を成膜後、金属酸化物的氢体 溶液を硫化亜鉛藻膜上に塗布乾燥した後加熱処理 をすることにより、硫化亜鉛薄膜上に钨緑性金属 酸化物藻膜を成膜するのと同時に、硫化亜鉛粒子 の粒界に钨緑性金属酸化物を折出させる特許請求 の範囲第3項記数の製造法。
- 3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、多結晶硫化亜鉛薄膜を用いたエレク トロルミネッセンス (以下、ELと略す) 索子及 びその製造法に関する。

「従来の技術及び本発明が解決しようとする問題点!

□~Ⅵ放半退体である硫化亜鉛はBL素子を始めとする発光素子、蛍光体としての応用が進められて来ている。特にBL素子は全固体型、平面発光素子となる特色があり、能動型ディスプレー関連素子としての応用が期待されている。

B L 素子は駆動方式によって直流型及び交流型に分けられ、更には蛍光体層の種類によって薄膜で蛍光体層が構成される薄膜型、及び蛍光体をポリマー中に均一に分散させて複合化した膜厚のやや大きい分散型の2方式に分類されている。

このうち、薄膜型EL素子用硫化亜鉛蛍光体薄膜は真空落着法、スパッタリング法、分子線エピタキシー (MBE法)、原子層エピタキシー法 (ALE法)による製造方法が知られており、これらはすべて高真空下での成膜技術によるものである。高真空下での成膜技術ではピンホールの少ない、緻密な膜質が得られる反面、化学量論性にお

においてやや劣り、そのためこの膜に電場を与えると発光に関与しない瀕れ電復が大きくなって、 素材は優れていながら膜質がやや劣るため輝度が 上がらなかったり、発光効率の低い膜という新た な問題点が発生し、その解決をはかる必要が生じ て来ている。

「問題点を解決するための手段」

本発明者等は、上記の問題点を解決するため観意研究の結果、この粒子堆積構造の硫化亜鉛薄膜の粒界に絶縁性金属酸化物を折出させて緻密性及び耐電圧特性を向上させることにより、既存の真空技術による薄膜已し業子と同等以上の輝度並びに発光効率を有する性能が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。

即ち、本発明の第1は多結晶酸化亜鉛醇膜を用いたEL素子において、破化亜鉛の粒界に結縁性金属酸化物を折出させた層を有することを特徴とする薄膜EL素子を、本発明の第2は多結晶硫化亜鉛醇膜を用いたEL素子を製造するに際し、硫化亜鉛の粒界に铂縁性金属酸化物を折出させるこ

いて不安定で欠陥構造を多く含む殴質になる場合 や、生理性に乏しく、原料が高価であったり、大 面積の製験が困難となるなどの問題点が指摘され ている。

これらの問題点に対して、本発明者等は有機延 鉛化合物溶液の歯布加熱分解法によって、EL用 硫化亚鉛薄膜を常圧プロセスで作る技術を発明し 、先に特許出願済みである(特願昭60-852 82号)。この方法は、上記問題点の解決と におか、活性剤はそのまま膜中に残る為外の であり、活性剤はそのまま膜中に残る為体の であり、たけ剤はそのまま膜中に残る の制御が容易であり、膜中のこれらの活性剤の 度分布が均一であること、欠陥を作りにくい から、薄膜BL用材料としての基本性能としては 非常に優れていることが判明している。

しかしながら、薄膜 B L にした場合、前述の真空技術により成膜された硫化亜鉛薄膜の微細構造は、柱状構造をしており緻密性に優れているのに対して、塗布法硫化亜鉛薄膜の微細構造は、いわゆる粒子堆積構造をしているため上記より級密性

とを特徴とする薄膜EL素子の製造法をそれぞれ 内容とするものである。

本発明の硫化亜鉛の粒界に絶縁性金属酸化物を 析出させた層を有するBL用薄膜は、下記の方法 により製造することができる。

の硫化亜鉛薄膜を成膜後、金属酸化物前駆体溶液を硫化亜鉛薄膜上に塗布乾燥した後加熱処理をすることによって、硫化亜鉛粒子の粒界に絶縁性金属酸化物を析出させる。

② 堕布法硫化亜鉛薄膜の成膜時に、予め堕布液中に絶縁性金属酸化物前駆体溶液を加えておき、硫化亜鉛薄膜合成と同時に粒界に絶縁性金属酸化物を析出させる。

これらの3方法のうち、①の方法において、碇 化亜鉛の粒界に絶縁性金属酸化物が折出している ②、③の方法は、1回の塗布焼成工程によって本発明の効果が得られる利点がある反面、加熱雰囲気が不活性ガス雰囲気あるいは硫化雰囲気となる為、残留カーボン、不用の硫化物等の副生を防いで膜の可視光透過性を保つ必要上、金属酸化物的駆体溶液の種類を①より更に限定する必要があ

金旗酸化物前駆体の溶解に用いられる溶螺は、 前駆体の種類、コーティングの方法、前述の①~ ②の成膜法に応じて通宜選定する必要があるが、 具体例として水;炭素数1~20迄の1個又は多 価アルコール;これらのアルコールと嬉酸、酢酸 プロピオン酸等のカルボン酸とのエステル;炭 **A**.

又、焼成後の膜中において硫化亜鉛に対する金 属酸化物の組成比が 0.5以下、特に好ましくは、 0.3から 0.03の範囲であることが本発明の効果 を得る為の必要な条件である。

本発明に用いられる絶縁性金属酸化物としては、可視光に対して透明性があり体積固有抵抗値でi×10° Q・ca以上であることが好ましく、例えばB、Be、Mg、Al、Si、Ca、Ga、Ge、Ti、Cr、Fe、Co、Ni、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Sb、Sn、in、Ba、Pb、Bi、Ta、W、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb等の金属酸化物が挙げられ、中でもB、Mg、Al、Si、Ga、Ge、Ti、Y、Zr、Nb、Sb、Sn、Pb、Bi、Ta、La、Smが特に本発明に好ましい結果を与える。又、上記の金属から選ばれる2種以上の複合金属酸化物も同様に本発明に有用である

これらの金属を含む金属酸化物前駆体溶液を用

素数20迄のケトン、エーテル:ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族溶媒;メチルセルソルブ、エチルセルソルブ等のグリコールエーテル铒; N-メチルジピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等の窒素含有有機溶媒のうちの一種又は二種以上の混合溶媒が挙げられる。

又、これらの金属酸化物前駆体の希釈率は化合物の種類にもよるが通常金属含有量として1~3 0 重量%の範囲で用いるのが好ましい。

これらの塗布方法としては、浸漬塗布法、スピンコート法、ロールコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、スプレー塗布法等の通常用いられる海膜のコーティング方法の応用が可能である。又鹽布後の乾燥温度は用いられる海媒の種類に応じて適宜調整する必要があり、50~250 での範囲で行われる。更に加熱処理温度は膜中に含まれる有機成分の除去、膜の緻密化促進の為過常350で以上で、基板の耐熱性にもよるが700で以下の温度で15分以上加熱される。加熱野

囲気は蛍光体薄膜中の硫化亜鉛が酸化するのを防ぐ為、窒素、アルゴン等の不活性ガスを用いるのが好ましいが炭化物の生成を防ぐ為5モル%以下の酸素を混入させる場合もある。

これら①~②の方法で得られるBL用譲設は破化亜鉛の製法に由来して粒子堆積構造を有してしるが硫化亜鉛に加えるドーパント、あるいはこれらの製膜方法によって粒径、膜厚の調整が可能であるが、BL素子発光層に106V/c■以上の高電界がかかる為、駆動電圧と発光効率、輝度のバランスから、構成している硫化亜鉛の粒径は0.01~0.5μm、膜厚は0.03~2.0μmの範囲が実用的である。

更に本発明で効果が明らかとなった硫化亜鉛の 粒界に絶縁性金属酸化物を析出させた層によって 膜の発光効率、耐電圧が向上するが、この層の生 成の確認は膜の深さ方向の表面分析(ESCA、 SIMS)、分析電子顕微鏡(STEM)による 解析、あるいは膜の断面を希敵等でエッチング処 理したのち走査電子顕微鏡で観察することによっ

又、上記の「TO基板上に比較試料として、マンガンを 0.5 m o 1 %ドーピングした硫化亜鉛のターゲットを用いて、基板温度 1 8 0 で、製膜速度的 5 人 / s e c 、製膜時の真空度 2 × 1 0 ° の条件で電子ビーム 落着を実施して、膜厚約 4 0 0 0 人の硫化亜鉛膜を作った。この試料を B とする

て可能となる。

これら本発明によるEL薄膜を発光素子として 用いるには、膜の厚さ方向に電圧をかけることで 速成できるが、交流、直波等の駆動方式の違称が、交流、 を発表する。例えば、面流を積なられては を関がある。例えば、面流を積なられては を関がある。例えば、面流を積なられては を作るかなでは、 を作るかなはないのでをしているができない。 を作るかなはないでは を作るかなはないできない。 が置となる様ななはいできない。 が置いているのによるのでは を作るかなはないできない。 が適いできない。 が適いできない。 が適いできない。 が適いできない。 が適いできない。 が適いできない。 が適いできない。 が適いできない。 ののだけなない。 ののだけなない。 ののだけなない。 ののだけるとしい。 ののだけるとしい。 ののでは、 ののでは、 ののではないできる。 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののできる。 ののでは、 ののできる。 ののできる。 ののできる。

「実施例」

以下、実施例及び比較例をもって本発明を更に 詳しく説明するが、当然ながら本発明は実施例の みに限定されるものではない。

実施例 1

2 - エチルヘキサン酸亜鉛(金属亜鉛合有率 1 5.0 w t %) 2 5.0 g とマンガンジアセチルアセ

テトラエチルシリケートの4量体50.0gにエチルアルコール200gを加え、攪拌しながら無水酢酸5.0g徐々に加えて反応させて加水分解条件をコントロールしたSiO。膜形成用塗布液を調整した。(Si濃度8.0wt%)

この溶液中に試料A及びBを浸漬し15cm/minの引き上げ速度にて大気中に引き出し、次に100℃15分間乾燥したのち窒素雰囲気下600℃1時間焼成した。

これらの試料の断面を希塩酸でエッチングした 後、走査電子顕微鏡で観察したところ、試料 A に コーティングしたものは粒子堆積構造の硫化亜鉛 薄膜と約1000人の粒界にSIO。が折出した 層、そして約1000人のSiO。膜の3層構造 であった。この試料をCとする。

一方、試料Bにコーティングしたものの断面は 柱状構造の硫化亜鉛層と約1500人のSiO。 膜の2層構造であった。この試料をDとする。

これらの試料 A ~ D の表面に電極としてアルミニウムを落着して下地の透明導電膜の間に、交流

(50 Hz) 包荷を与えて輝度~電圧特性を測定して図-1にプロットした(デバイスのサイズ 5mp)。この図から分かる通り、試料 C は既存の真空技術による発光層(例えば試料 B 又は D)に較べて同等以上の性能を示すことから、本発明の効果は明らかである。

比較例1

実施例1で作った試料A(塗布法硫化亜鉛膜)及びB(EB療者硫化亜鉛膜)の上に、マグネトロンスパッタリング装置でSiO。ターゲットを用いて、約10人/secの製膜速度にて約200人のSiO。膜を作った。この試料をB及びFとする。

この試料と、Fの断面を設でエッチングした後、走査電子顕微鏡で観察したところ、双方の試料とも硫化亜鉛の粒界にSiO。が折出している層は見つからなかった。

又このE、F膜の表面にアルミニウム電極を作り、下地膜との間に交流電荷を与えてEし特性を評価したところ、EはFに比べて発光輝度耐電圧

ものと判明した。

実施例3

ピスマストリイソプロポキシド 2 5.0 gをイソプロピルアルコール 1 5 0.0 gに溶解したのち、加水分解速度調整の為 3.5 gのアセチルアセトンと 2.0 gの無水酢酸を加え、加熱還流をして酸化ピスマト形成用前駆体溶液とした。

次に、共沈法によって作られた硫化亚鉛コロイド(マンガン約1.0重量%ドープ) 65gを加え、十分に復律して半透明のペースト状とし、これを実施例1で用いた!TO基板上にスピンコーターでコーティングし、更に乾燥後、窒素中600で一時間焼成して透明な薄膜を得た。

段差計を用いて膜厚を測定した結果、この膜の 厚さは、約5500人であった。更に、この膜上 にアルミニウム落着して交換電圧を印加したとこ ろ昼間の室内でも視認出来る十分な輝度のEL発 光が得られた。

实施例 4

アクリル酸亜鉛 (金属亜鉛含有量31 w t %)

ともにかなり劣っていることが料明した。

实施例 2

アルミニウムブトキシジイソプロポキシド 2 0.0 8 を酢酸イソプロピル 7 5.0 8 に溶かし、 機伴しながらアセチルアセトン 5.0 8 を加えて、 酸化アルミニウム形成用前駆体溶液を作った。この溶液中に実施例 1 で用いた試料 A、 Bに引き上げ速度 1 0 ce/minで投資塗布した後、アルゴンガス中 7 0 0 で 1 時間加熱したのち、 試料 A、 B と共に膜上にアルミニウムを落着して B し 素子を作った。この試料を G、 H とする。

この君子に交流電圧を印加して発光特性を測定し、これらの性能評価結果を図-2にまとめた。これから分かる通り、酸化アルミニウムをコーティングした試料GはEB落着法による試料Bを上回り、Hと同等以上の性能を示しており本発明の効果が如実に現れている。

尚、この試料 C を衷面分析の結果、硫化亜鉛と酸化アルミニウムの混在層が約 8 0 0 人出来ており、この層による発光効率の性能向上効果による

20 8とマンガンジアセチルアセトナート 0.17 8 そしてエチルアルコール 60 8 を加えて機伴して均一溶液としたのち、実施例 1 で用いた SiO m 膜形成用塗布液を 10 8 更に加えて機伴し前駆体溶液とした。この溶液中に 1 T O 基板を浸過させたのち、 15 c ■ / m in の速度で引き上げ 80 でで 1時間乾燥して透明な硬化酸を得た。

この膜を酸化雰囲気中450℃で加熱して有機成分を除去し、次に硫化水素にガス置換して1時間加熱した。更に窒素雰囲気に変えて600℃1時間加熱処理して、膜厚5000人の透明な薄膜を得た。

この膜の裏面分析をESCA及びSIMSにより実施したところ、含まれている元素成分(Zn、S、Mn、Si、O)が共に深さ方向にほぼ一定であることが判明した。又、IN塩酸水溶液中に実施例Iで用いた試料A、Bと共にこの基板を30分浸漬して取り出したところ、SiO。成分を含まない試料A、Bの膜は完全にエッチングされているのに対してこの腹は殆ど変化がみられな

かった。このことは、添加したSiO。成分が膜中に均一に偏折していることによるものと考えられる。

又、この敗上にアルミニウム電極を付け交換電場を印加したところ、試料Aに比べて約5倍以上の耐電圧及び発光輝度を示しており、本発明の効果が極めて大きいことが分かった。

「作用・効果」

叙上の通り、本発明によれば、例えば酸化亜鉛パリスタが粒界に酸化ビスマス等の高抵抗層を折出させている構造と同様に、硫化亜鉛粒子の粒界に絶縁性酸化物を折出させることによって、電場を印加した場合に生じる粒界の漏れ電流を減少させ発光効率を向上させる。 更には、この効果以外に破化亜鉛薄膜の緻密性を向上させて耐電圧特性を上げると共に、ピンホールによる膜の短絡防止効果も得られる。

4. 図面の簡単な説明

図~1及び図-2は、いずれも輝度~電圧特性 を示すグラフである。



